

# SJ/Z

中华人民共和国电子工业部指导性技术文件

SJ/Z 3206.1~14-89

---

## 发射光谱分析方法 (基础标准)

1989-02-10发布

1989-03-01实施

---

中华人民共和国电子工业部 批准

# 目 录

1	SJ/Z 3206.1—89	发射光谱分析实验室的一般要求·····	1
2	SJ/Z 3206.2—89	发射光谱分析用激发源及其性能要求·····	5
3	SJ/Z 3206.3—89	发射光谱分析用仪器及其性能要求·····	13
4	SJ/Z 3206.4—89	光谱感光板使用通则·····	31
5	SJ/Z 3206.5—89	光谱化学分析用感光板和胶片的照相处理方法·····	37
6	SJ/Z 3206.6—89	发射光谱用石墨电极的形状和尺寸·····	43
7	SJ/Z 3206.7—89	光谱分析标准样品的制备通则·····	47
8	SJ/Z 3206.8—89	发射光谱分析取样和制样方法通则·····	53
9	SJ/Z 3206.9—89	标准样品或样品均匀度检验方法·····	57
10	SJ/Z 3206.10—89	发射光谱定性分析方法通则·····	65
11	SJ/Z 3206.11—89	发射光谱定量分析方法通则·····	71
12	SJ/Z 3206.12—89	电真空材料发射光谱分析方法通则·····	83
13	SJ/Z 3206.13—89	半导体材料发射光谱分析方法通则·····	87
14	SJ/Z 3206.14—89	光谱化学分析误差及实验数据处理方法通则·····	95

## 标准样品或样品均匀度检验方法

---

本方法适用于大量制造的棒块状、粉末状标准样品（简称标样）或样品的均匀性检验。检验采用发射光谱分析技术。

本方法是以数据统计理论为基础而制定的。

### 1 引用标准

- 1.1 GB 9259—88 发射光谱分析名词术语
- 1.2 SJ/Z 3206.7—89 光谱分析标准样品的制备通则
- 1.3 SJ/Z 3206.14—89 光谱化学分析误差及实验数据处理方法通则
- 1.4 SJ/Z 3206.8—89 发射光谱分析取样和制样方法通则

### 2 说明

- 2.1 本方法以随机取出一定数量样品的测量数据，来判断标样总体的均匀性。
- 2.2 试验用仪器和设备不应使测量数据产生系统误差，否则须进行校正。
- 2.3 本方法只对一种被测定成分的测量数据进行计算，其它成分可照此方法处理。
- 2.4 使用的分析线或分析线对，不应受其它谱线的干扰或背景的影响。
- 2.5 方法采用的置信水平，依被检验标样应满足的产品技术条件而定。
- 2.6 计算使用的数据可以是测定成分的含量，或表示含量的其它测量值。

### 3 取样

- 3.1 棒块状标样，从每个标样的不同部位取出30~50个有代表性的样品，编号并加标签，采用抽签方式或利用随机数表（见附录A），从中最少抽取15个样品用于检验。
- 3.2 粉末标样，从标样包装瓶中任意取出30~50个样品，编号并加标签，用抽签方式或用随机数表（见附录A），最少抽取15个样品用于检验。
- 3.3 如果样品少于15个，就需要对全部样品进行检验。

### 4 检验方法

- 4.1 利用最佳的光谱分析条件，将抽取的m个样品，每个记录或读取n次被测定成分的分析结果，一般n应在4次以上。数据列于表1。